

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2005年1月27日 (27.01.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/007571 A1

(51)国際特許分類: C01B 31/02

(21)国際出願番号: PCT/JP2003/009172

(22)国際出願日: 2003年7月18日 (18.07.2003)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

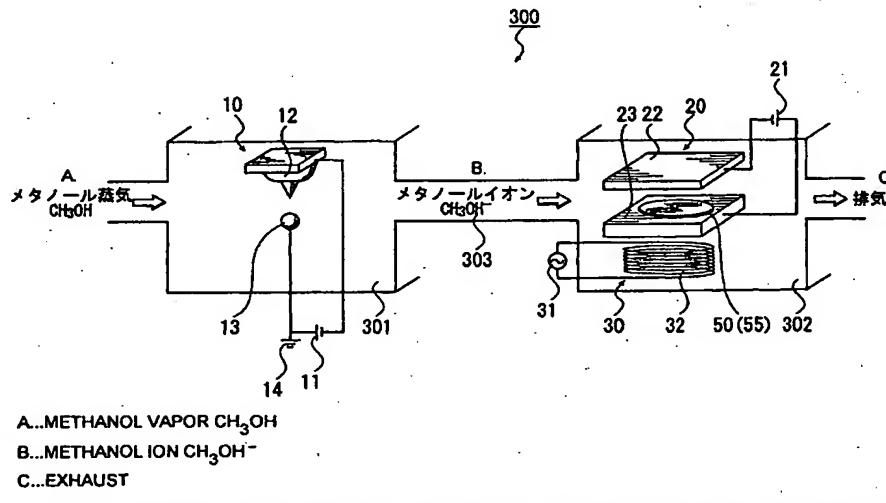
(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 矢野謙典
(YANO,Kensuke) [JP/JP]; 〒112-0005 東京都文京区
水道2-3-10 ランテルナ小石川502 Tokyo (JP).(74)代理人: 荒船博司, 外(ARAFUNE,Hiroshi et al.); 〒
162-0832 東京都新宿区岩戸町18番地 日交神楽坂
ビル5階 Tokyo (JP).(81)指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[総葉有]

(54)Title: CARBON NANOTUBE MANUFACTURING APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING CARBON NANOTUBE

(54)発明の名称: カーボンナノチューブ製造装置及びカーボンナノチューブ製造方法



(57)Abstract: A carbon nanotube manufacturing apparatus (1000, 2000, 3000) comprises an ionizing means (e.g. a negative ion generator (10)) for ionizing a vapor of a certain carbon-containing compound, an electric field generating means (e.g. a direct-current power supply (21), a cathode (22) and an anode (23)) for generating an electric field and a heating means (e.g. a high-frequency heater (30)) for heating a growth substrate (50, 55) disposed within the electric field generated by the electric field generating means. A carbon nanotube manufacturing method in which an ionized vapor of the carbon-containing compound is passed through the electric field and brought into contact with the heated growth substrate, so that a carbon nanotube (4) is orientationally grown on the growth substrate is adopted.

(57)要約: カーボンナノチューブ製造装置(1000、2000、3000)において、所定の炭素含有化合物の気化ガスをイオン化するイオン化手段(例えば、マイナスイオン発生器10)と、電界を発生する電界発生手段(例えば、直流電源21とカソード電

WO 2005/007571 A1

[総葉有]



SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI 特許 (BF, BJ, CR, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 國際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

極 22 とアノード電極 23) と、電界発生手段により発生された電界内に配置される成長基板 (50、55) を加熱する加熱手段 (例えば、高周波加熱器 30) と、を備え、イオン化された炭素含有化合物の気化ガスを、電界内を通過させることにより、加熱された成長基板に接触させることで、カーボンナノチューブ (4) を成長基板に配向成長させるカーボンナノチューブ製造方法を採用した。